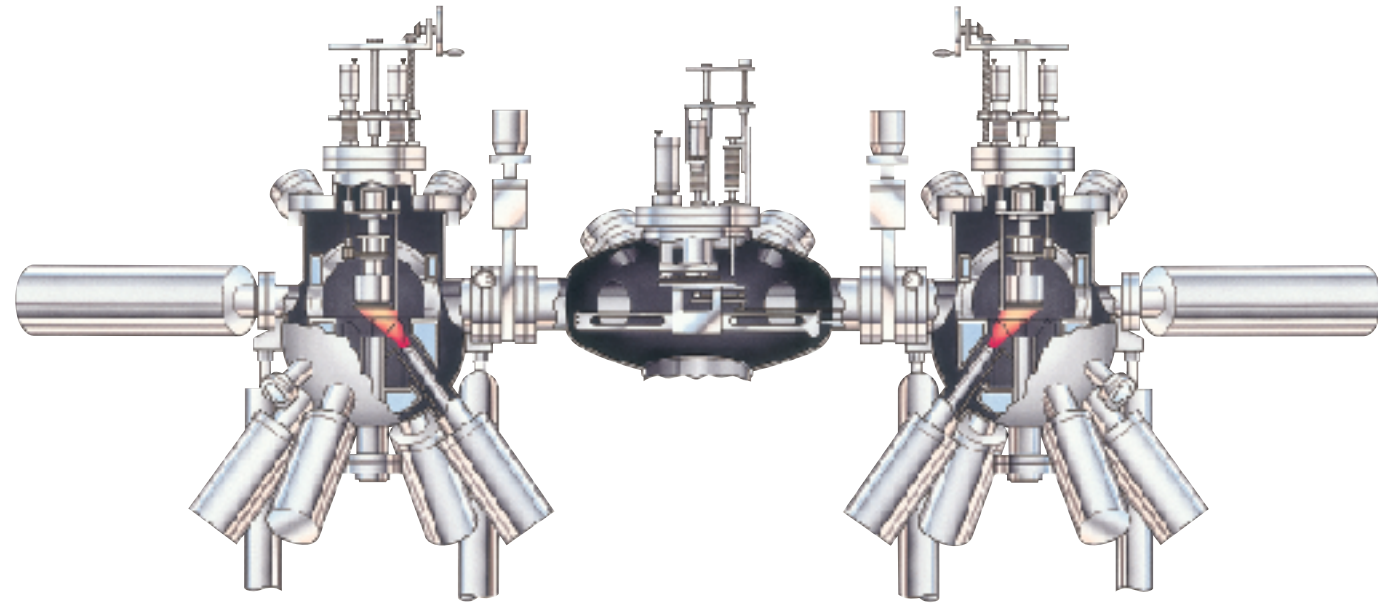


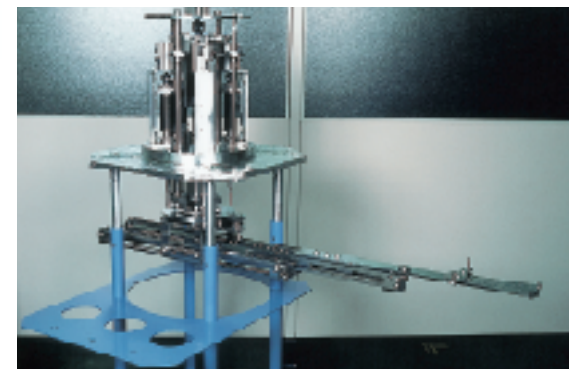
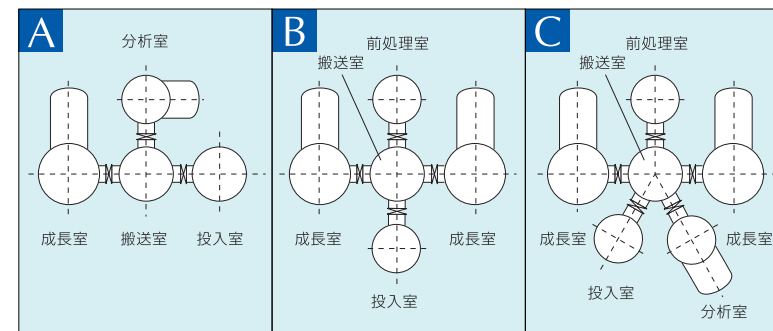
回転伸縮が可能なアーム搬送システムを内蔵した超高真空の搬送室をセンターにして、独立した成長室を複数接続することにより、超高真空一貫システムが構成でき、異種材料の積層、超高真空中での分析、評価などが可能となります。



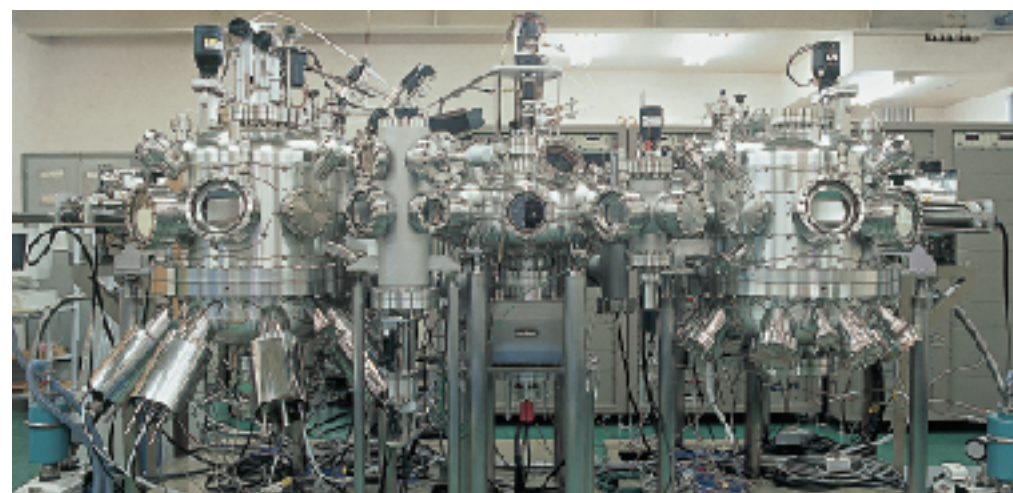
本装置は、Si用MBE成長用MBE装置と化合物半導体用MBE装置を回転伸縮アーム搬送システムを内蔵した搬送室にて接続し、さらに真空トロックにて化合物半導体用MOCVD装置に接続しております。これにより、MBE-MOCVDの両装置を用いた異種材料の成長を、大気に触れさせることなく行うことができます。また、マルチチャンバ側の搬送室には、STM室も接続されており、成長直後の表面分析を行うことが可能です。

マルチチャンバへの拡張

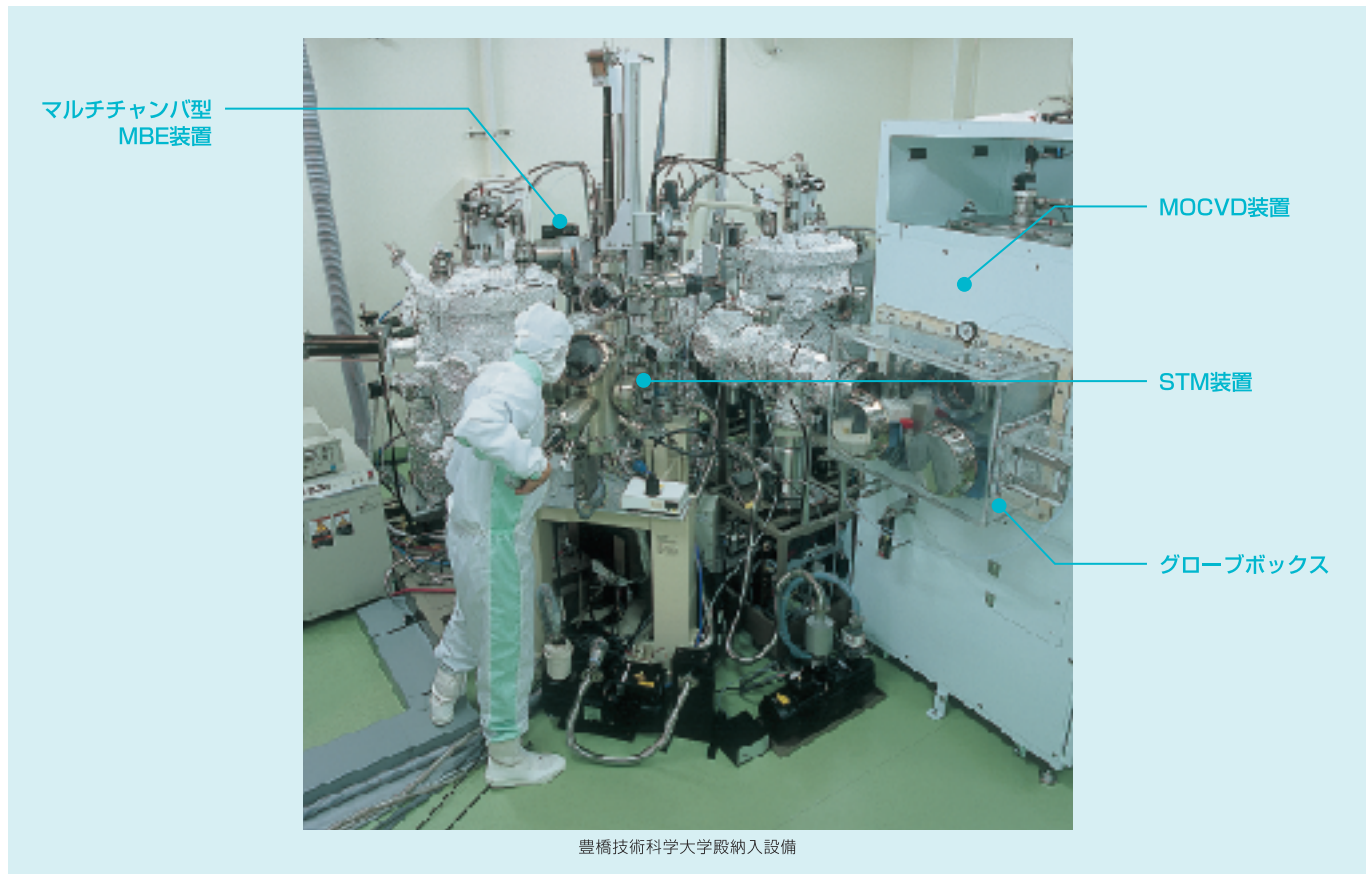
アーム搬送システムの採用により、サテライト構成のマルチチャンバへのシステムアップが可能となります。省スペース化、拡張性に貢献します。



当社の長年のノウハウによる超高真空用アーム搬送システム。超高真空中で回転伸縮可能な3段アームが360°方向に試料を搬送します。量産機での採用をはじめ、研究室でも多くの実績があります。



GaN用マルチチャンバ型MBE装置 / 上智大学取納入設備



豊橋技術科学大学取納入設備

装置レイアウト

